ロボット関連技術PRカード

1. 企業概要

会社名	日新技研株式会社 <small>にっしんぎけん</small>			代表者名	比佐 吉宏		
				窓口担当	比佐 吉宏		
事業内容	新素材開発装置の製造販売			URL	https://www.nissin-giken.co.jp/		
主要製品	高周波誘導加熱装置、アーク溶解装置、その他加熱炉、蒸着用電子銃及び電源						
所在地	〒358-0033 埼玉県入間市狭山台 4-14-10						
電話/FAX 番号	04-2935-1411/04-2935-1390			E-mail	hisa@nissin-giken.co.jp		
資本金(百万円)	70	設立年月	1974年9月	売上(百万円)	1400	従業員数	42

2. PR事項

『高周波誘導加熱と真空技術を使った新素材開発装置メーカー』

試験機により材料の試作が可能です。お気軽にお問合せ下さい。

●製品紹介

<h4>金属系新素材関連装置</h4> <ul style="list-style-type: none"> 各種金属を加熱・溶解し、様々な実験、開発を行う 国内外の企業・大学・公共機関に数多くの納入実績 <table border="1"> <tr> <th>液体急冷凝固装置</th> <th>粉末作製装置</th> <th>高周波溶解装置</th> <th>アーク溶解装置</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 液体急冷凝固装置 急冷薄片製造装置 液中紡糸装置 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ガスアトマイズ装置 水アトマイズ装置 回転ディスク装置 回転電極装置 ハイブリッド装置 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 大気溶解装置 真空溶解装置 高純度活性 金属溶解装置 ゾーンメルティング装置 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 真空アーク溶解装置 アーク キャスティング装置 傾角鋳造実験装置 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ホットプレス装置 メカニカル アロイング装置 連続鋳造装置 </td> </tr> </table>	液体急冷凝固装置	粉末作製装置	高周波溶解装置	アーク溶解装置	その他	<ul style="list-style-type: none"> 液体急冷凝固装置 急冷薄片製造装置 液中紡糸装置 	<ul style="list-style-type: none"> ガスアトマイズ装置 水アトマイズ装置 回転ディスク装置 回転電極装置 ハイブリッド装置 	<ul style="list-style-type: none"> 大気溶解装置 真空溶解装置 高純度活性 金属溶解装置 ゾーンメルティング装置 	<ul style="list-style-type: none"> 真空アーク溶解装置 アーク キャスティング装置 傾角鋳造実験装置 	<ul style="list-style-type: none"> ホットプレス装置 メカニカル アロイング装置 連続鋳造装置 	<h4>高周波電源 (トランジスタ・インバータ式)</h4> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <h5>高周波電源</h5> <ul style="list-style-type: none"> 自社開発 (最適設計・メンテナンスが容易) 世界最小クラス・コンパクト MB別置きでフレキシブルな設置が可能 直列共振による安定した制御性 </div> <p>一部にSiCパワーモジュールを採用し、従来よりも高効率化を達成しています。</p>		
液体急冷凝固装置	粉末作製装置	高周波溶解装置	アーク溶解装置	その他									
<ul style="list-style-type: none"> 液体急冷凝固装置 急冷薄片製造装置 液中紡糸装置 	<ul style="list-style-type: none"> ガスアトマイズ装置 水アトマイズ装置 回転ディスク装置 回転電極装置 ハイブリッド装置 	<ul style="list-style-type: none"> 大気溶解装置 真空溶解装置 高純度活性 金属溶解装置 ゾーンメルティング装置 	<ul style="list-style-type: none"> 真空アーク溶解装置 アーク キャスティング装置 傾角鋳造実験装置 	<ul style="list-style-type: none"> ホットプレス装置 メカニカル アロイング装置 連続鋳造装置 									
<h4>結晶関連装置</h4> <table border="1"> <tr> <th>CZ装置</th> <th>SiC関連装置</th> <th>その他</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> 酸化物単結晶引上装置 高磁場中単結晶引上装置 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> SiC・AlN単結晶成長装置 SiC-CVD装置 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 高温アニール装置 GaP・InP高压合成装置 LPE装置 マイクロ引下げ装置 </td> </tr> </table>	CZ装置	SiC関連装置	その他	<ul style="list-style-type: none"> 酸化物単結晶引上装置 高磁場中単結晶引上装置 	<ul style="list-style-type: none"> SiC・AlN単結晶成長装置 SiC-CVD装置 	<ul style="list-style-type: none"> 高温アニール装置 GaP・InP高压合成装置 LPE装置 マイクロ引下げ装置 	<h4>電子ビーム</h4> <table border="1"> <tr> <th>5kW EB源・電源</th> <th>10kW EB源・電源</th> <th>20kW EB源・電源</th> </tr> <tr> <td>超小型。ARコートが主目的</td> <td>一般蒸着から超光学多層膜</td> <td>大面積高融点材料向け</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>被蒸着物 電子ビーム (270°偏向) 蒸発物 EB源 電源 ルツボ</p> </div>	5kW EB源・電源	10kW EB源・電源	20kW EB源・電源	超小型。ARコートが主目的	一般蒸着から超光学多層膜	大面積高融点材料向け
CZ装置	SiC関連装置	その他											
<ul style="list-style-type: none"> 酸化物単結晶引上装置 高磁場中単結晶引上装置 	<ul style="list-style-type: none"> SiC・AlN単結晶成長装置 SiC-CVD装置 	<ul style="list-style-type: none"> 高温アニール装置 GaP・InP高压合成装置 LPE装置 マイクロ引下げ装置 											
5kW EB源・電源	10kW EB源・電源	20kW EB源・電源											
超小型。ARコートが主目的	一般蒸着から超光学多層膜	大面積高融点材料向け											

- これらの装置群をお客様のご要望に沿ってカスタマイズし製造販売しております。
- 主要研究機関や企業の研究所、大手素材メーカーへ多数の納入実績がございます。
- 『こうすれば出来る』という案を提案して、お客様の課題解決をサポートします。

3. 特記事項 (得意技術以外にPRしたい事項 例: 特許情報、応用分野、表彰・認定)

- 期待される応用分野: 金属用 3D プリンタ、パワー半導体 (SiC、GaO 等)、電池、熱電素子、磁性材料、その他
- 今後の取組み: 大学等との共同研究を通じた新製品やプロセス開発の強化